

52. Treffen "Heißprozesse und RTP"

21.05.2025, centrotherm international AG, Blaubeuren

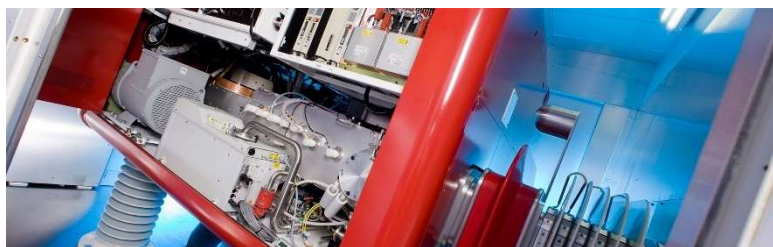
Vortragsprogramm (Stand 19.05.2025)

13:00 Uhr – 14:00 Uhr	Check-in, Get-together
14:00 Uhr – 14:05 Uhr	Begrüßung Wilfried Lerch, Fraunhofer EMFT, München
14:05 Uhr – 14:20 Uhr	Vorstellung centrotherm Helge Haverkamp, centrotherm international AG, Blaubeuren
14:20 Uhr – 14:45 Uhr	Laserbasiertes Heizen: Selektive und globale Heizstrategien Sebastian Roder, Fraunhofer ISE, Freiburg
14:45 Uhr – 15:10 Uhr	TLM measurements and challenges in ohmic contact formation for 4H-SiC p-type contacts Maximilian Ley, Fraunhofer IISB, Erlangen
15:10 Uhr – 15:25 Uhr	Applications benefitting from Multiple-Spike Processes in Helios V Systems Runbang Shao, Mattson Thermal Products GmbH, Dornstadt
15:25 Uhr – 15:55 Uhr	Ambient related effects on oxide thickness distribution specific for SiC oxidation Tamara Fidler, centrotherm international AG, Blaubeuren
15:55 Uhr – 16:10 Uhr	Low-Pressure RTP Applications on Helios LP System Alexandr Cosceev, Mattson Thermal Products GmbH, Dornstadt
16:10 Uhr – 16:30 Uhr	tbd Toni Sandbrink-Koblenz, memsstar, Livingston
16:30 Uhr – 16:50 Uhr	Diskussionsforum Wilfried Lerch, Fraunhofer EMFT, München

Gemeinsames Abendessen:

19:00 Uhr

Wirtshaus zur Brezel, Ulmer Gasse 8, 89073 Ulm



68. Treffen "Ionenimplantation"

22.05.2025, centrotherm international AG, Blaubeuren

Vortragsprogramm (Stand 19.05.2025)

09:00 Uhr – 10:00 Uhr	Check-in, Get-together
10:00 Uhr – 10:05 Uhr	Begrüßung Volker Häublein, Fraunhofer IISB, Erlangen Werner Schustereder, Infineon Technologies Austria AG, Villach
10:05 Uhr – 10:20 Uhr	Vorstellung centrotherm Dr. Helge Haverkamp, centrotherm international AG, Blaubeuren
10:20 Uhr – 10:35 Uhr	Obsolescence management Cyrille Guillou, Ion Beam Services, Peynier
10:35 Uhr – 11:05 Uhr	Vorstellung/Update des sub-atmosphärischen Anliefersystems ION-X® für Implantgase Volker Heilmann, Numat Technologies, Chicago
11:05 Uhr – 11:30 Uhr	Schnelle CV-Messung als Methode des Implanter Monitorings Thomas Obitz, X-FAB, Dresden
11:30 Uhr – 11:55 Uhr	PMR-C für die Überwachung der Ionenimplantation von SiC (PMR-C for ion implant monitoring of SiC) Ádám Kun, SEMILAB Semiconductor Physics Laboratory Co. Ltd., Budapest
11:55 Uhr – 12:05 Uhr	IBS European OEM Cyrille Guillou, Ion Beam Services, Peynier
12:05 Uhr – 12:30 Uhr	Nissin - Advanced Implant Technologies Reinhard Wagner, ICW GmbH, Velden am Wörthersee
MITTAGSPAUSE 12:30 Uhr – 13:30 Uhr	
Ab 13:30 Uhr	Führung centrotherm Hr. Mutschler, centrotherm international AG, Blaubeuren
Im Anschluss	Diskussionsforum/ Schlussworte Volker Häublein, Fraunhofer IISB, Erlangen

VERANSTALTUNGSENDE:

Gegen 15:30 Uhr